电化学方法制备 ZnO 纳米颗粒掺杂类金刚石 薄膜及其场发射性能研究*

张培增1) 李瑞山2)3) 谢二庆1)† 杨华2)3) 王璇2) 王涛4) 冯有才2)

1) (兰州大学磁学与磁性材料教育部重点实验室,兰州 730000)

2)(兰州理工大学理学院,兰州 730050)

3) (兰州理工大学甘肃省有色金属新材料重点实验室,兰州 730050)

4)(西北师范大学物理与电子工程学院,兰州 730070)

(2011年6月1日收到; 2011年11月1日收到修改稿)

采用液相电化学沉积技术制备了 ZnO 纳米颗粒掺杂的类金刚石 (DLC) 薄膜,研究了 ZnO 纳米颗粒掺杂对 DLC 薄膜场发射性能的影响. 利用 X 射线光电子能谱、透射电子显微镜、Raman 光谱以及原子力显微镜分别对薄膜的 化学组成、微观结构和表面形貌进行了表征. 结果表明: 薄膜中的 ZnO 纳米颗粒具有纤锌矿结构, 其含量随着电解 液中 Zn 源的增加而增加. ZnO 纳米颗粒掺杂增强了 DLC 薄膜的石墨化和表面粗糙度. 场发射测试表明, ZnO 纳米 颗粒掺杂能提高 DLC 薄膜的场发射性能, 其中 Zn 与 Zn+C 的原子比为 10.3%的样品在外加电场强度为 20.7 V/μm 时电流密度达到了 1 mA/cm². 薄膜场发射性能的提高归因于 ZnO 掺杂引起的表面粗糙度和 DLC 薄膜石墨化程度 的增加.

关键词: ZnO 纳米颗粒, 类金刚石薄膜, 电化学沉积, 场发射

PACS: 81.05.U-, 79.70.+q, 61.46.Df

1 引 言

类金刚石 (DLC) 薄膜是主要由 sp³和 sp²杂化 碳组成的非晶碳膜.由于具有低电子亲和势和高 化学稳定性,近年来 DLC 薄膜场发射性能的研究 受到了高度关注,在冷发射电子枪、平板显示器等 领域中显示出广阔的应用前景^[1].但是,由于 DLC 薄膜电阻率过大,导致难以形成较大的场发射电 流^[2,3],因此很多研究者尝试对 DLC 材料进行掺 杂,以降低薄膜电阻率,从而提高场发射性能.目前 已实现 N, Si 等非金属元素和 Ti, Ag 等金属元素 对 DLC 薄膜的掺杂.场发射测试结果表明,掺杂 能显著提高 DLC 薄膜的场发射性能,包括降低场 发射开启电场、增大发射电流、提高发射稳定性 等^[4-7].

ZnO 是一种重要的 II-VI族直接带隙化合物半导体材料,室温下禁带宽度为 3.37 eV, 激子结合

能高达 60 meV, 它具有优异的光电性能, 在光电器 件、传感器等领域都具有广泛的应用 [8-10]. 纳米 结构的 ZnO 材料具有负电子亲和势和高化学稳定 性,场发射性能优异,可以用作场发射阴极材料^[11]. 近年来纳米结构 ZnO 材料场发射性能的研究受到 了广泛的关注. Tseng 等^[12] 以竖直排列的 ZnO 纳 米线作为场发射阴极,在 24 V/μm 的外加电场下电 流密度达到了 0.1 mA/cm². 但是 ZnO 材料机械性 能欠佳,杨氏模量仅为110 GPa,在一些条件比较 严苛的工作环境下不能达到要求,一定程度上限制 了 ZnO 材料的应用. 将 ZnO 纳米颗粒掺入 DLC 薄 膜,可以降低 DLC 薄膜的体电阻,从而提高薄膜的 场发射性能;同时,DLC 薄膜对 ZnO 纳米材料的包 覆可以改善其机械性能. Hsieh 等^[13] 尝试利用真空 过滤阴极技术将 ZnO 纳米颗粒掺入 DLC 薄膜,结 果显示 DLC 薄膜的包覆有助于提高 ZnO 材料的杨 氏模量. ZnO 纳米材料本身就是一种优异的场发射

*兰州理工大学博士科研基金(批准号: BS10200904)和教育部科学技术研究计划重点项目(批准号: 211188)资助的课题.

http://wulixb.iphy.ac.cn

[†] E-mail: xieeq@lzu.cn

^{© 2012} 中国物理学会 Chinese Physical Society

材料,将 ZnO 纳米颗粒掺入 DLC 薄膜有可能同时 利用两种材料在场发射方面的优势,得到一种性能 优异的场发射材料.

本文利用液相电化学沉积方法将 ZnO 纳米颗 粒掺杂到 DLC 薄膜中. 与气相法相比, 液相法具 有低温、低能耗、设备简单易控、易于实现掺杂 等特点^[14],目前利用电化学沉积技术已成功制备 了 N, S 等非金属元素和 Au, Ti 等金属元素掺杂 的 DLC 薄膜^[15-17]. 实验中通过调节电解液中 Zn 源的含量,得到不同 ZnO 含量的 DLC 薄膜,研究 掺杂 ZnO 纳米颗粒对 DLC 薄膜结构的影响,并结 合薄膜表面形貌和微结构的变化分析 ZnO 掺杂 对 DLC 薄膜场发射性能的影响,以期进一步优化 场发射阴极材料的性能.

2 实 验

实验采用简单的电解池装置,类似 于 Namba^[14] 使用的双电极系统. 阴极采用 n 型 (100) 硅衬底 (10 mm×20 mm×1 mm), 电阻 为 7—13 Ω, 阳极为铂电极, 两极之间距离保持 为 7 mm. 在沉积之前, Si 片依次用 5%HF 水溶 液、去离子水、分析纯乙醇、分析纯丙酮各超 声清洗 10 min, 最后用 N₂ 气吹干备用. 实验采 用的电解液为 Zn₂[C₃₂H₄₂N₈O₁₃]Cl₄/甲醇溶液,其 中分析纯 (99.5%) 甲醇作为碳源, 合成的超大分 子 Zn₂[C₃₂H₄₂N₈O₁₃]Cl₄ 作为 ZnO 的前驱体 ^[18]. 为了调节薄膜中 ZnO 纳米颗粒的含量, 电解液采用 不同浓度的 Zn₂[C₃₂H₄₂N₈O₁₃]Cl₄/甲醇溶液, 实验 中采用的浓度分别为 0.05, 0.08 和 0.15 g/ml. 电化 学沉积的沉积电压为 1000 V. 沉积时间为 8 h. 沉积 过程中水浴温度保持在 50-60°C. 为了进行对比, 在相同条件下以甲醇为电解液制备了 DLC 纯碳膜.

采用 X 射线光电子能谱 (XPS) 和 Raman 光谱 分析了薄膜的化学成分和微观结构, 进一步的结 构检测采用透射电子显微镜 (TEM). 用原子力显微 镜 (AFM) 测量了薄膜的表面形貌. 场发射特性测 试采用二极管型结构, 在 10⁻⁴ Pa 的真空下完成.

3 结果及分析

3.1 样品的表征

XPS 可以定量测定薄膜的化学成分. 根据 DLC 和 ZnO-DLC 薄膜的 XPS 全谱分析, Zn 与 Zn+C 的

原子比 R 随着电解液中 Zn 源含量的增加而增加, 依次为 3.54% (0.05 g/ml Zn2[C32H42N8O13]Cl4/甲 醇), 10.3% (0.08 g/ml) 和 15.41% (0.15 g/ml), 这意 味着利用液相电沉积方法 Zn 元素被成功地掺入 了 DLC 薄膜, 且 Zn 含量随着电解液中 Zn 源含量 的增加而增加.为了描述方便,我们将 DLC 样品 命名为样品 A, ZnO-DLC 样品按 Zn 含量从低到 高依次命名为样品 B、样品 C 和样品 D. 为了明 确 Zn 元素在复合薄膜中的键合形式以及 Zn 掺杂 对 DLC 薄膜的影响, 我们对 Zn 2p 和 C 1s 的 XPS 精细谱进行了分析,如图 1 所示.对于 Zn 2p 峰, Zn 2p1/2 峰和 Zn 2p3/2 峰位于 1045.4 和 1022.4 eV, 这与 ZnO 相应的标准 XPS 特征峰相符合,意味 着 ZnO-DLC 样品中的 Zn 原子是与 O 原子结合, 以 ZnO 的形式存在^[19]. 从图 1(a) 可以看出, 随 着 Zn 含量的增加, Zn 2p 峰位向低能方向偏移, 作 者推测是由于 Zn 含量的增加使 DLC 基质中 ZnO 纳米颗粒粒径增加,结合能更高的表面原子比例随 之下降,因此Zn2p峰的结合能下降.图1(b)显示C



图 1 不同 ZnO 含量样品的 XPS (a) 样品 B、样品 C、 样品 D 的 Zn 2p 能谱; (b) 样品 A、样品 B、样品 C、样 品 D 的 C 1s 能谱

1s 峰位于 284.5—285.5 eV, 这意味着电沉积制备的碳基质中含有 sp³和 sp²两种杂化形式的碳, 与 纯碳膜的样品 A 的 C 1s 峰相比, ZnO-DLC 复合膜 的 C 1s 峰向低结合能方向偏移, 其原因可能是 ZnO 的掺杂导致 DLC 基质的石墨化程度增强 [20].

图 2 所示为 DLC 和 ZnO-DLC 复合膜的 AFM 图像. 由图 2 可以看出, 随着 ZnO 含量的增加, 薄膜 表面微凸起增大, 薄膜的粗糙度逐渐增大.



图 2 利用 AFM 得到的样品形貌 (a) 样品 A; (b) 样品 B; (c) 样品 C; (d) 样品 D

为了进一步检测复合薄膜的微结构,我们 用 Raman 光谱仪和 TEM 分别对样品进行了检测. 图 3 是不同 ZnO 含量样品的 Raman 光谱. 如图 3(a) 所示,所有 ZnO-DLC 薄膜样品都在 584 cm⁻¹ 处显 示了 ZnO 的 A1 纵向光学 (LO) 声子模式振动峰, 并且 LO 峰的位置随着 ZnO 含量的增加几乎不发 生变化,这与文献 [21] 所报道的 ZnO 的 LO 振动模 式与颗粒大小无关的结果是一致的. 如图 3(b) 所 示的高波数区域, ZnO 纳米颗粒 LO 模式的交叠和 联合导致 1158 cm⁻¹ 附近出现了二级特征峰^[22]; 在 1200—2000 cm⁻¹ 的区域, DLC 和 ZnO-DLC 样 品都出现了 D 峰和 G 峰, 这意味着电沉积制备得 到的样品都具有类金刚石特征. 随着 ZnO 含量的 增加, D 峰和 G 峰都向高波数方向移动, 且 G 峰强 度增强,这归因于 DLC 基质的石墨化程度增强,这 与 XPS 检测的结果一致.

为了进一步明确 ZnO 在 DLC 基质中的分布 和微观结构,用 TEM 对薄膜进行了检测,结果如 图 4 所示. 检测证实通过电沉积嵌埋在 DLC 基 质中的球形 ZnO 纳米颗粒直径约为 4 nm, 分散良好, 没有明显的团簇现象. 高分辨率透射电子显微镜 (HRTEM) 检测显示薄膜中纳米颗粒晶面间距约为 0.27 nm, 与六方晶系纤锌矿结构中 (002) 晶面间距极为接近, 由此推测电化学沉积在 DLC 基质中的 ZnO 纳米颗粒是纤锌矿结构.

3.2 场发射特性分析

图 5(a) 是 DLC 膜及 ZnO-DLC 膜的场发射 J-E 曲线. 从 J-E 曲线可以看出, 与纯 DLC 膜相 比, ZnO 的掺杂使 DLC 膜的场发射性能有了显著 改善. 首先是开启电场下降. DLC 膜在外加电场 约为 13.5 V/μm 时开始出现电子发射现象, 随着薄 膜中 ZnO 含量的增加, 开启电场降低到了 7 V/μm. 其次是发射电流密度提高. ZnO 的掺杂使发射电 流密度显著增大, 其中样品 C 的电流密度在电场 为 20.7 V/μm 时达到了 1 mA/cm², 这一数值可以满 足大多数场发射阴极的应用需求.



图 3 不同 ZnO 含量样品的 Raman 光谱 (a) 样品 B、 样品 C、样品 D 在较低波数的 Raman 光谱; (b) 样品 B、 样品 C、样品 D 在较高波数的 Raman 光谱

检测表明,随着外加电场的增加,发射电流 密度呈现指数增大,在23.5 V/µm的外加电场 下,发射电流密度最大的样品 C 的电流密度 可达 1.5 mA/cm². 值得注意的是, 对于 R 值最 高(10.41%)的样品 D. 发射电流随着外加电场增 加并非一直保持指数上升, 而是从 17 V/um 开始变 缓,表现为随外加电场线性增大的趋势.这种场发 射特性的改变,可能是 ZnO 纳米颗粒造成的表面 微凸起和 DLC 基质微结构改变共同作用的结果. AFM 图像表明, ZnO 掺杂使 DLC 薄膜的表面粗糙 度增加,在外加电场下表面的不均匀会引起局域的 场增强,有利于电子的场发射,因此随着复合薄膜 中 ZnO 含量的增加,薄膜表面粗糙度增加,场发射 电流也随之增大.但是,作为一种功函数相对较高 的半导体材料, ZnO 掺入会造成 DLC 基质中 sp² 与 sp³比例的提高,这一点已经被 XPS 和 Raman 光 谱检测所证实,因此随着 ZnO 含量的增加,薄膜功 函数增大,从而导致场发射性能下降,对于 ZnO 含 量最高的样品 D, 在外加电场超过 17 V/μm 的区域, 功函数已经成为影响场发射的主要因素,所以场发 射电流呈现饱和,并且随着外加电场线性增大,不 再表现出呈指数增加的特征.





图 4 样品 C 的 TEM 和 HRTEM 图像 (a) TEM 图像; (b) HRTEM 图像

根据场发射的 Fowler-Nordheim(FN) 理论^[23], 场致发射电流密度方程为

$$J = A(\beta E)^2 \exp\left(\frac{-B\varphi^{3/2}}{\beta E}\right),\tag{1}$$

其中, *J* 为发射电流密度, φ 为功函数, *E* 为外加电场强度, β 为场增强因子. 方程 (1) 表明, $\ln(J/E^2)$ -1/*E* 曲线的斜率与 $B\varphi^{3/2}/\beta$ 成正比. 图 5(b) 是样品场发射对应的 FN 曲线. 从图 5(b) 可以看到, 样品 A、样品 B 和样品 C 的 FN 曲线呈线性, 属于场电子发射. 假设场增强因子 β 为 1, 从 FN 曲线的斜率可以计算出样品 A、样品 B 和样品 C 的功函数依次为 69, 59 和 43 meV. 较低的功函数有利于场电子发射, 因此样品 C 表现出最佳场发射性质. 事实上, 由于场增强因子的存在, 样品的功函数远大于 FN 理论的估算值. 样品 D 在低场区域的功函数

为 36 meV, 与其他样品非常接近, 但是在高场区域 样品 D 的 FN 曲线偏离了直线, 出现了场发射电流 的饱和,其发射行为已经不能用 FN 理论来解释,这 与场发射 J-E 曲线的结果是一致的.



图 5 样品 A、样品 B、样品 C、样品 D 的 J-E 曲线和 FN 曲线 (a) J-E 曲线; (b) FN 曲线

4 结 论

利用液相电沉积的方法,制备了纤锌矿结构 ZnO 纳米颗粒掺杂的 DLC 薄膜.通过增加电解液中 Zn 源的含量提高了薄膜中 ZnO 的含量.检测证实, ZnO 的掺入使薄膜表面粗糙度增加,并且

促进了 DLC 基体的石墨化. ZnO 的掺入使薄膜的 场发射性能增强, Zn 与 Zn+C 的原子比为 10.3%的 复合薄膜在 23.5 V/μm 的外加电场下发射电流 为 1.5 mA/cm²,显示了最佳的场发射性质. 结果表 明, ZnO-DLC 复合薄膜可以成为一种优秀的场发 射阴极材料.

- Ilie A, Ferrari A C, Yagi T, Robertson J 2000 Appl. Phys. Lett. 76 2627
- [2] Ma H Z, Zhang L, Yao N, Zhang B L, Hu H L, Wen G L 2000 *Diam. Relat. Mater.* 9 1608
- [3] Silva S R P, Carey J D, Guo X, Tsang W M, Poa C H P 2005 Thin Solid Films 79 482
- [4] Wu Y H, Hsu C M, Chia C T, Lin L N, Cheng C L 2002 Diam. Relat. Mater. 11 804
- [5] Ahmed S F, Mitra M K, Chattopadhyay K K 2007 Appl. Surf. Sci. 253 5480
- [6] Liang H F, Liang Z H, Liu C L, Meng L G 2010 Appl. Surf. Sci. 256 1951
- [7] Paul R, Dalui S, Pal A K 2010 Surf. Coat. Technol. 204 4025
- [8] Wang L, Giles N C 2003 J. Appl. Phys. 94 973
- [9] Yang P, Yan H, Mao S 2002 Adv. Funct. Mater. 12 323
- [10] Lan W, Tang G M, Cao W L, Liu X Q, Wang Y Y 2009 Acta Phys. Sin. 58 8501 (in Chinese) [兰伟, 唐国梅, 曹文磊, 刘雪芹, 王印 月 2009 物理学报 58 8501]
- [11] Lee C J, Lee T J, Lyu S C, Zhang Y, Ruh H, Lee H J 2002 Appl. Phys. Lett. 81 3648

- [12] Tseng Y K, Huang C J, Cheng H M, Lin I N, Liu K S, Chen I C 2003 Adv. Funct. Mater. 13 811
- [13] Hsieh J, Chua D H C, Tay B K, Teo E H T, Tanemura M 2008 Diam. Relat. Mater. 17 167
- [14] Namba Y 1992 J. Vac. Technol. A 10 3368
- [15] Li R S, Xie E Q, Zhou M, Zhang Z X, Wang T, Lu B A 2008 Appl. Surf. Sci. 255 2787
- [16] Wan S H, Wang L P, Xun Q J 2010 Electrochem. Commun. 12 61
- [17] Kundoo S, Saha P, Chattopadhyay K K 2004 Mater. Lett. 58 3920
- [18] Xia Y N 2010 Ph. D. Dissertation (Beijing: Graduate University of Chinese Academy of Sciences) (in Chinese) [夏娅娜 2010 博 士学位论文 (北京: 中国科学院研究生院)]
- [19] Jung D R, Son D, Kim J, Kim C, Park B 2008 Appl. Phys. Lett. 93 163118
- [20] Irmer G, Dorner-Reisel A 2005 Adv. Eng. Mater. 7 694
- [21] Rajalakshmi M, Arora A K, Bendre B S, Mahamuni S 2000 J. Appl. Phys. 87 2445
- [22] Cuscó R, Alarcón-Lladó E, Ibáñez J, Artús L, Jiménez J, Wang B G, Callahan M J 2007 Phys. Rev. B 75 165202
- [23] Fowler R H, Nordheim L W 1928 Proc. Roy. Soc. A 119 173

The fabrication and field emission properties of ZnO nanoparticles-doped diamond-like carbon films by electrochemical deposition*

Zhang Pei-Zeng¹) Li Rui-Shan²⁾³) Xie Er-Qing^{1)†} Yang Hua²⁾³) Wang Xuan²) Wang Tao⁴) Feng You-Cai²)

(Key Laboratory for Magnetism and Magnetic Materials of Ministry of Education, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)
(School of Science, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China)

3) (Key Laboratory of Advanced Non-Ferrous Material of Gansu Province, Lanzhou University of Technology, Lanzhou 730050, China)
4) (College of Physics and Electronic Engineering, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China)

(Received 1 June 2011; revised manuscript received 1 November 2011)

Abstract

The formation of ZnO nanoparticles embedded in diamond-like carbon (DLC) thin film, deposited by electrochemical technique without post-processing, is observed. The effect of ZnO doping on the field emission (FE) property of DLC film is investigated. The chemical composition, the microstructure, and the surface morphologies of the sample are characterized by X-ray photoelectron microscopy, transmission electron microscopy, Raman spectrum, and atomic force microscope (AFM). It is shown that the ZnO nanoparticles are of a wurtzite structure and the content of ZnO increases with Zn source increasing in electrolyte. The ZnO doping enhances both the graphitization and the surface roughness of the DLC film, which is verified by Raman spectrum and AFM. By the ZnO doping, the FE properties of the DLC film are improved. An emission current density of 1 mA/cm² is obtained at an electric field of 20.7 V/ μ m for the film with a Zn/(Zn+C) ratio of 10.3at%. The improvement on the FE properties of the ZnO-doped DLC film is analyzed in the context of microstructure and chemical composition.

Keywords: zinc oxide nanoparticles, diamond-like carbon film, electrochemical deposition, field emission **PACS:** 81.05.U–, 79.70.+q, 61.46.Df

^{*} Project supported by the Doctoral Scientific Research Foundation of Lanzhou University of Technology, China (Grant No. BS10200904) and the Key Program of Science and Technology Research of Ministry of Education, China (Grant No. 211188).

[†] E-mail: xieeq@lzu.cn